第7章 低摩擦往復動用リップシールの開発

7.1 緒 言

往復動用リップシールの設計目標は、高い密封性能を維持しながら摩擦係数の低減を達 成することである。第6章では単一リップおよび複列リップに規則的突起を付与した場合 の摩擦および密封特性を検討し、突起の存在は摩擦低減には役立つが漏れを助長すること を指摘した。また、第4章ではリップシールを多段に組み合わせて、多段接触圧力分布形 態が摩擦・密封特性に与える影響について系統的実験を実施し、特定の組合せの場合には シール間圧力が上昇するが、その発生は流体潤滑の逆問題によって説明できることを示す とともに、シールのはみ出しをもたらすシール間圧力の上昇は摩擦力の増加をもたらすが、 この原因がシール間圧力の上昇に伴う緊迫力の増加によることを推測した。さらに、漏れ 量は大気側シールに大きく影響されるが、漏れは油側に存在する最も密封性能の高いシー ルによって制御されることを明らかにした。

ところで、自動車のショック・アブソーバーなどに使用される往復動用リップシールで は、密封圧力によるリップの変形を小さく抑えるため、複列式リップ形状が多く採用され ている。このようなリップ変形を抑えることを目的とした複列リップシールでは、リップ 間圧力が例え上昇したとしても、シール装着すき間内へのリップのはみ出しは発生せず、 リップ間圧力の発生は、逆に緊迫力の低下をもたらすと予測され、これが摩擦力の低下を 誘起すると考えられる。なお、第4章の結論からも分かるように、リップ間圧力の発生は 実用複列リップシールの油側リップを漏れ誘起形に変更することによってもたらされると 考えられるが、密封性能は大気側リップが密封形である限り大きく変化しないと推測され る。

このような視点から本章では、複列リップシールを用いて、高密封・低摩擦を実現できる 高性能往復動用リップシールの開発可能性を検討する。

7.2 実験装置および実験方法

実験は、図7.1に装置概略図を示すように、第6章で用いたものと同一の実験装置に 複列リップ間の圧力計測を追加して実施した。繰り返しの往復しゅう動によって複列リッ プ間に発生する圧力は、図7.1のA部詳細に示すようにリップ間谷部に埋め込まれた内 径0.25mmの軟質チューブを介して圧力変換器で検出した。この計測信号は、往復動軸の 位置および摩擦力と同時にシンクロスコープでモニタしながらデータレコーダに記録した。



Fig. 7.1 Schematic diagram of testing device



Fig.7.3 Lip angle on the rod and typical contact pressure distributions of three types of lip seals

Table 7.1 Contact conditions

	Sealing pressure (MPa)		
	0	0.25	0.49
Interference (mm)	1.6~1.8		
Total contact load (N)	43~48	146~151	250~255
Contact width (mm)			
Oil side lip	0.1~0.2	2 0.2~0.4	0.3~0.6
Air side lip	0.1~0.2	0.4	0.5~0.6

Table 7.2 Properties of paraffinic mineral oils

Oil	Kinematio (mm 313 (K)	c viscosity ^{1²/s)} 373 (K)	Specific gravity
b	10	2.5	0.8773
с	47	6.9	0.8768
d	320	24	0.8969

Table 7.3 Test conditions

Length of stroke : 50 (mm)
Number of cycles : 0.3~3 (Hz)
Sealingpressure : 0~0.5 (MPa)
Temperature : Room temperature

図7.2に供試シールの形状寸法の概略を示し、図7.3に各シールの軸接触部のリップ 角度を示す。Aタイプシールは両リップとも密封性に主眼を置いた通常の形状を有する シールである。これに対して、B、Cタイプは大気側リッフをAタイプと同一の形状にし、 油側リップのみの形状を変えたシールである。表7.1に各シール試料の軸との接触状態 を示す。ここで、緊迫力*Pr*(Total contact load)は、各密封圧力条件下でリップ間に圧 力発生がない状態において、第6章と同じ解析条件の有限要素法により求めた値を示して いる。図7.3にはMüllerの方法⁽¹⁶⁾による接触圧力分布の計測結果がシール形状ごとに示 されている。ここで、油側リップの緊迫力PrはAタイプ>Bタイプ>Cタイプの順で小さ くなり、特にCタイプは低下が大きく、また接触幅も狭くなる結果となっている。この低 下の原因は、試料の油側リップの油側表面はメスカットで成形されて他の金型成形表面よ り粗く仕上がっているため、圧力計測スリットからの圧力抜けが起こったことによるもの と考えられる。

供試密封流体には、3種類のパラフィン系鉱油を用いた。表7.2にその特性を示す。 粘性係数の算出に必要な温度は、第6章と同様にしゅう動部に近いシールリップ背面の円 周対向2カ所を熱電対によって計測してその平均値を用いた。表7.3に試験条件を示す。 試験時の雰囲気温度は室温で、また、試験は計測されるリップ間圧力と摩擦力が安定した 後まで継続して行った。その試験時間は10~30分であった。

7.3 リップ間圧力の発生機構への逆問題の適用

第4章において多段組み合わせシールの漏れ量を実質的に支配するシールは大気側シー ルであることを明らかにした。この知見に立脚すれば、本シール形状の場合においても漏 れ量は大気側リップによって主として支配されるといえる。この観点から、図7.3に示 した静的に測定された接触圧力分布に着目すれば、各シールとも大気側リップの接触圧力 分布形態は油側に偏っており、|dp/dx|max,P> |dp/dx|max,M となっていることが分かる。これ は、式(2-26 c)から負の漏れ、つまり大気側への漏れ量はないことを意味する。す なわち、本章で採用したシールは密封状態を呈するものと予測される。

さて、両リップ間に発生する圧力については、押し・引き各行程中、両リップそれぞれ に形成される流体膜厚の大小関係が重要となる。押し行程における油側リップの最大圧力 こう配 |dp/dx|max,P は、Aタイプ>Bタイプ>Cタイプの順であるので、式(2-19) より流体膜厚 hmはA<B<Cと予測される。また、大気側リップの最大圧力こう配は、 各タイプともAタイプの油側リップの |dp/dx|max,P とほぼ同等である。したがって、押し 行程中の両リップそれぞれに形成される膜厚の差に応じた流体がリップ間に蓄積されると 考えると、Aタイプではリップ間へ流体の蓄積はなく、Cタイプが最も蓄積量が多いこと になり、各タイプの蓄積流量はA<B<Cの順になると見なされる。引き行程における大

気側リップに対する |dp/dx|max,M は各タイプでほぼ等しいため、大気側に同量の流体が存 在するとすれば、大気側リップを通過してリップ間に流れ込む流量はほぼ等しいと考えら れる。一方、油側リップを通過して油側へ流れ込む流量は、油側リップでの |dp/dx|max,M がA<B<Cの順であるので、A>B>Cの順となる。したがって、往復両行程中にリッ プ間に蓄積される流量はA(=0)<B<Cの順に多くなる。つまり、Aタイプではリップ 間に正の圧力はほとんど発生せず、各シールのリップ間圧力は次式に示す順に高くなると 推定される。

$$A \not > T \not < B \not > T \not < C \not > T \not$$
 (7-1)

すなわち、いずれのタイプのシールも大気側リップは大気側に漏れ出た流体をリップ間 に引き戻す構造をしているが、Aタイプの油側リップはリップ間の流体を油側に戻す構造 を、BおよびCタイプの油側リップはAタイプとは逆に油側流体をリップ間に送り込みや すい構造をしている。

7.4 実験結果および考察

7.4.1 接触圧力分布形態の影響

前節において各シールを特徴づける接触圧力分布がリップ間に発生する圧力の大きさを 支配することが予測された。このリップ間圧力は摩擦あるいは密封特性に影響を与えると 考えられる。そこで、この影響を検討するために、密封圧力 0.25 MPa の下で実験を実施 した。なお、以下に示す摩擦係数 fm は押し・引き両行程中央での摩擦力FP、FMの平均値 を緊迫力Prで除すことによって求めた。fm および無次元特性数Gの値の算出に必要なPrの 値は、同一作動条件に対して各シール性能を比較評価するため 表 7.1 に示した各密封 圧力条件下でのリップ間圧力 0 に対応する値を用いた。

図7.4に密封圧力Ps=0.25MPaの条件における各シールタイプごとのリップ間 圧力Pilと特性数Gの関係を示す。Aタイプにおいてはリップ間圧力の発生はほと んど認められず、Bタイプでは0.04~0.1 MPaの圧力が発生し、Cタイプでは3試料中

で最も高い 0.25~0.42MPa の圧力が発生している。すなわち、リップ間圧力はA<B<C の順に高くなっており、前節での推定式(7-1)の大小関係が成立していることが分 かる。なお、密封圧力*Ps* = 0.25MPaの全試験範囲において各シールタイプとも、リップ 間圧力の発生の有無にかかわらず、密封状態を呈した。これは、前節で述べたように、 大気側リップが密封状態を支配することを裏付けている。



Fig.7.4 The relationship between interlip pressure Pil and duty parameter G



Fig.7.5 The relationship between frictional coefficient $f_{\rm m}$ and duty parameter G

図 7.5 に摩擦係数 f_m と無次元特性数Gの関係を示す。各シールタイプとも $G>10^5$ の 範囲では、式(2-20)に対応する $f_m \propto G^{1/2}$ の関係が成立しており、流体潤滑が支配 的であることが分かる。また、各タイプごとの全試験範囲における摩擦係数の順位は、A >B>Cとなっており、リップ間発生圧力が高いほど摩擦が低減されていることが分かる。 図 7.6はG=2.3×10⁻⁶の条件におけるCタイプのリップ間圧力 Pil および摩擦力Fの時間 t に対する変動を示す。時間経過に伴って圧力 Pil が約 0.4MPaまで上昇し、これに追随して Fが11Nから5Nまで半分以下に低減されている。リップ間発生圧力Pilが安定するまでの 時間は、Gが大きくなるほど短くなり、また、同一Gの条件ではCタイプの方がBタイプ より短くなる。このときの摩擦力Fの低減は、図7.7(a)に示すモデル図のように リップ間発生圧力 Pil がシール緊迫力Prを軽減するように作用して、Fを低減させるため と判断される。図7.7(b)はリップ間発生圧力 Pil により低減される緊迫力Prを、ガラス 軸を用いた顕微鏡観察により求めた谷部面積の変化を考慮して各密封圧力条件ごとに算定 した結果(実線)である。図中には $G > 10^{-5}$ の範囲で計測された安定時における Pil とそ れに対応して算出されるPrの値がプロットされている。Aタイプでは実験中にPilの発生 がないため、緊迫力 Pr は初期緊迫力と変わらず同じ値となり、密封圧力 Ps の増加ととも に同じ割合で増加している。BタイプおよびCタイプの初期緊迫力(*Pil*の発生のない状 態)は、各密封圧力 Ps ごとに Aタイプとほぼ同じ値をとるが、Pil が発生するとその緊迫 カPrは低下している。CタイプはBタイプよりもリップ間発生圧力 Pil が大きく、緊迫力 Prの低下が大きい。なお、各密封圧力Psに対して、リップ間圧力Pil安定時の緊迫力Prの 増加割合は、各試料ごとにほぼ一定値を示し、Aタイプ>Bタイプ>Cタイプの順に小さ くなっている。

しかし、リップ間圧力の発生がないAタイプの摩擦力とリップ間圧力が発生するB およびCタイプの摩擦力とを比較すると、リップ間圧力の発生は緊迫力の低下以上の効果 をもたらすことが分かる。すなわち、Bタイプではリップ間発生圧力が約 0.1MPa でCタ イプの約 1/4 であるが、これから算定される緊迫力の低下以上の摩擦力の低下がBタイプ では発生している。また、図 7.5の fm - Gプロットから混合潤滑領域と考えられる G= 2×10⁷ 近傍ではBおよびCタイプの摩擦力はほぼ同程度である。なお、第4章では、多段 シールを用いて実施したしゅう動面の直接観察の結果、大気側リップが潤滑不足の状態









になると摩擦が増加することが判明した。これらの事実は、リップ間圧力の発生はリップ 間に流体の蓄積をもたらすことによって大気側リップの潤滑に大きく寄与することを示唆 している。

以上のように、複列リップシールに発生するリップ間圧力は同一密封条件下で摩擦力を 低減させるように作用するため、極めて有用な効果をもたらすといえる。これは、複数個 のシールを多段に組み合わせて用いたときのシール間発生圧力が、破損不具合に直接結び つく過大変形やはみ出しの現象の原因となること⁽⁴⁹⁾と逆の現象である。

7.4.2 密封圧力の影響

Cタイプにおけるリップ間圧力 Pu および摩擦係数 fm に及ぼす密封圧力 Ps の影響を図7. 8~図7.10に示す。図7.8および図7.9は、図7.4および図7.5と同様にリップ 間圧力 Pu が0の初期緊迫力Prを用いたときの結果であり、図7.10はリップ間発生圧力 Puにより低下した緊迫力Prを用いて算出したfm*とG*で図7.9を書き直したものである。 図7.9は作動条件に対する性能の比較評価に主眼を置き、図7.10はしゅう動部にお ける実質的な特性に主眼を置いたことに対応する。しかし、両者から導出される結論には 大きい相違点はない。なお、図7.8においてはリップ間圧力 Pu は、各Gで密封圧力 Ps の増加に伴ってほぼ同じ増加率で増加し、同じ密封圧力では G>10⁻⁵の範囲でほぼ一定 値を示している。ところで、各Ps において発生する Pu が谷部に作用してリップを拡張さ せる力 (Puによる拡張力)は、緊迫力を Pu の発生していない初期緊迫力の値から低減さ せるように作用するが、図7.7(b)からわかるように、G>10⁻⁵では Ps の増加に伴っ て増加する初期緊迫力 Pr に対してほぼ一定の割合(66~72%)を示している。すなわ ち、密封圧力の増加によって初期緊迫力 Pr が高くなるほど発生するリップ間圧力 Pu も高 くなっている。この実験事実は、密封圧力に依存する初期緊迫力によってリップ間圧力の 大きさが規定されることを示している。

使用上問題となる漏れは全実験のうちCタイプの密封圧力 *Ps* が 0.1MPa 未満でのみ発生 した。この場合の無次元漏れ量*Q*は1.0×10⁻¹⁰~5.5×10⁻⁷ (*q*=8.3×10⁻¹¹~9.8×10⁹ m³/s) であり、式(2-23)で示される*Q* ∝ *G*^{3/2}の関係がほぼ成立した。逆問題に基づく 予測に反するこの漏れの原因は、次のように考察される。密封圧力が大気圧のとき、



発生したリップ間圧力 Pil によって、Cタイプの緊迫力Pr は初期の47Nから全タイプ、 全実験条件の中で最低の約14N(30%)まで低下する。このような場合にはリップの接触領 域が相当狭くなるため、しゅう動によって動的に不安定となって漏れに至ったものと判断 される。

さて、図7.9 および図7.1 0から分かるように、 摩擦係数 fm は密封圧力にはほとん ど依存していない。すなわち、密封圧力が変化しても fm -G 曲線はほぼ同じである。こ れは、密封圧力 Ps の増加による初期緊迫力Pr の増加を、Ps の増加に追随して増加する リップ間圧力 Pil がほぼ一定の割合で軽減するためであると考えられる。すなわち、リッ プ間圧力 Pil によって低減される緊迫力Pr は、図7.7 (b)に示すように密封圧力 Ps の増加 に対してほぼ一定の低い増加率に押さえられているためと考えられる。密封圧力 Ps が変 化してもほとんど同じ摩擦特性となる Cタイプの結果は、摩擦係数の大きさに違いはある が、AタイプおよびBタイプにおいても同様の結果となることが確認されている。すなわち、 図7.5 と同様に摩擦係数 fm の値は同一G で比較すればAタイプ>Bタイプ>Cタイプの 順に低下しており、接触圧力分布が潤滑特性を基本的に規定することが分かる。

また、前述したように図 7.5、図 7.9 および図 7.1 0の $f_m - G \mathcal{T}_{□ッ}$ トは $G > 10^{-5}$ で は式(2-20)の $f_m \propto G^{1/2}$ の関係をほぼ満足しており、流体潤滑が支配的であるとい える。リップ間圧力 *Pil* もこの領域では *G*によらずシールごとにほぼ一定値を示している が、 $G < 10^{-5}$ においては *G*の減少とともに低下する傾向を示しており、この領域が *G*の減 少とともに流体潤滑が支配的でない領域に移行することを示すものといえる。

7.5 結 言

本章で得られた主な結論は次のようにまとめられる。

- (1) 複列リップ往復動用シールの摩擦・密封特性および複列リップ間の圧力発生機構は 流体潤滑の逆問題によって説明することができる。
- (2) すなわち、シールの基本的特性は接触圧力分布の形態によって支配される。
- (3) 図7.3のBタイプあるいはCタイプの断面形状を持つシールが誘起する接触圧力分 布形態の場合には両リップ間に正の圧力が発生する。
- (4) このリップ間圧力の発生は摩擦力の大きい低減をもたらす。
- (5) 上記摩擦力の低減は、リップ間圧力の発生による緊迫力の低減ならびに大気側リッ プの潤滑特性の改善によってもたらされる。
- (6) 密封圧力の増大による緊迫力の増加は、リップ間圧力の増加によって打ち消される ため、摩擦係数は密封圧力にほとんど依存しない。
- (7) Cタイプの密封圧力が低い場合を除いて、実用上問題となる漏れは検出不能で あった。

すなわち、密封特性に関するより精密な計測あるいは最適リップ形状など残された問題 はあるが、本章の結果は、現用の複列リップシールの主リップの形状を変更することに よって、充分な密封性能を維持し、摩擦低減が可能な往復動用シールの開発が可能である ことを示すものである。